

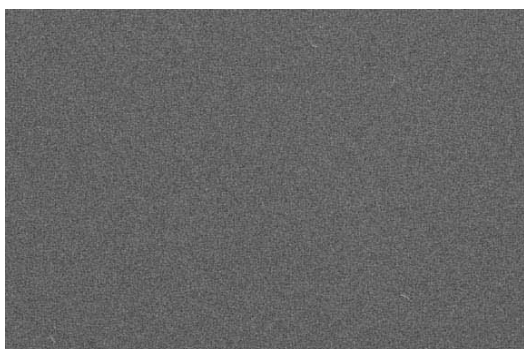
超精密真空チャック

究極を極めた平坦加工技術と精密加工技術の融合により、ウエハ吸着時の安定的な高精度保持とウエハ裏面パーティクルおよびスクラッチの大幅な低減を可能としました。

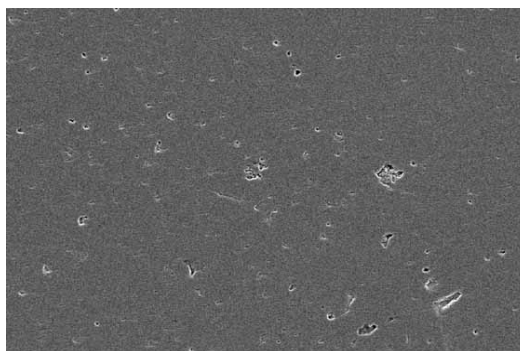
【特長】

- 高精度: 平面度 $0.2\mu\text{m}$, L/F $0.05\mu\text{m}$ 以下
- 材質選択性: 結晶化ガラス, SiC, 導電性セラミックス
- 形状制御: ウエハの形状に応じたチャック形状
- 低パーティクル性: ポアフリー、Double-Polishing

弊社推奨チャック材料研磨面比較(SEM)



ポアフリー材



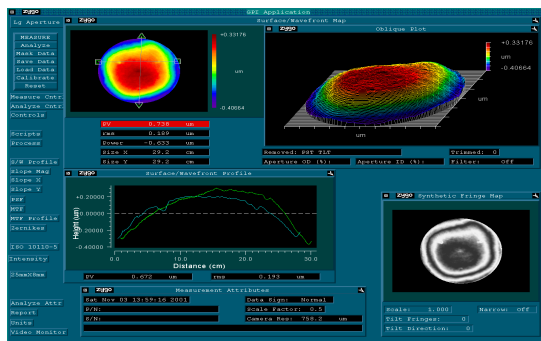
一般的なアルミナセラミックス

【用途】

- ウエハ検査機用などの真空吸着式チャック
- ウエハ加工用固定治具

【オプション】

- 当社オリジナル洗浄技術との組合せで更なる清浄化が可能になります。
- 当社オリジナル梱包箱使用による吸着面の非接触搬送で洗浄後の清浄化状態を保てます。
- ウエハ異物検査装置を用いての表面異物MAP作成が可能です。



Φ300ウエハ吸着後のレーザー干渉計測定参照データ

営業部 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビルディング 10階

TEL (03) 3271-5061

Mail: nc-sales@niterragroup.com